

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ФИЗИКА

Добряков С. Н., Привезенцев В. В. К вопросу о природе векторного обменного взаимодействия в двухспиновой системе	5
Хаврошкин О. Б., Быстров В. П. Сонолюминесценция и Sono-Fusion	7
Манухин В. В. Самораспыление тонких однородных пленок	14
Иголкин С. И. Натяжение пленок и давление Лапласа под искривленной поверхностью жидкости	21
Стафеев В. И. Термоэлектрические явления при инъекции неосновных носителей заряда	29
Несмелова И. М., Астафьев Н. И. Определение коэффициента поглощения кристаллов оптического германия по удельному сопротивлению	33
Хазба Г. С. Исследование тепловых характеристик халькогенида меди	36
Коршаковский С. И. Резонансная колебательная система за порогом чувствительности средств обнаружения информационных сигналов	39

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Боровиков П. В., Григорьев В. Ю., Кузнецов Ю. А. Параметрическая модуляция сигналов стохастическими колебаниями в ЛБВ с плазменным заполнением	47
Смирнов В. П., Алексеев Ю. А., Казеев М. Н., Койдан В. С., Ананьев С. П., Козлов В. Ф., Толстов Ю. С. О возможности получения нанопорошков при соударении металлических фольг, ускоренных давлением магнитного поля	54
Бурлаков И. Д., Болтарь К. О., Седнев М. В. Ионно-плазменные процессы в технологии изготовления матричных фоточувствительных элементов из КРТ	58
Васильев В. В., Войцеховский А. В., Дульцев Ф. Н., Земцова Т. А., Парм И. О., Соловьев А. П. Плазмохимическое осаждение пленок диоксида и нитрида кремния для пассивации поверхности КРТ	62

ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПУЧКИ

Гончаров Л. А., Григорьян В. Г. Источники ионов для операций ионно-лучевой технологии	67
---	----

ФОТОЭЛЕКТРОНИКА: ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА И ТЕХНОЛОГИЯ

Пономаренко В. П., Трошкин Ю. С., Филатов А. В. Сохраняемость параметров вакуумных фоторезисторов на основе CdHgTe	71
--	----

Зеневич А. О., Новиков Е. В. Исследование зонной чувствительности лавинных фотоприемников в режиме счета фотонов	76
--	----

Овсяк В. Н., Ярцев А. В. Исследование вольт-фарадных характеристик МДП-структур на основе МЛЭ CdHgTe <i>n</i> - и <i>p</i> -типа	80
--	----

Заславский А. В., Кузнецов П. А., Климанов Е. А., Хромов С. С. Сравнительный анализ схемотехнических принципов построения КМОП-мультиплексоров для многоэлементных фоторезисторов на основе PbS и PbSe	83
--	----

Бушман С. В., Горелик Л. И., Кравченко Н. В., Куликов К. М., Петров А. К. Регистрация коротких световых импульсов фотоприемными устройствами на основе фоторезисторов с большой инерционностью	86
--	----

Хитрова Л. М. Методы переноса отдельных блоков монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ и $InSb$ использованием клеев	89
--	----

Васильева М. Ф., Герасюк А. К., Гоев А. И., Потелов В. В., Сеник Б. Н., Сухачев А. Б., Жигарновский Б. М., Кириленко В. В., Ноздрачев А. В. Высококачественные оптические покрытия для видимой и ближней ИК-областей спектра, созданные на базе новых пленкообразующих материалов — дититаната гадолиния и дититаната лютеция	91
---	----

Тимофеев О. В., Вилкова Е. Ю., Шихов В. А., Кушнир С. Р., Радбиль Б. А. Исследование процесса полирования поликристаллических халькогенидов цинка с использованием смол	98
---	----

Гавришук Е. М., Савин Д. В., Иконников В. Б., Сторожнева Т. И. Получение сульфоселенидов цинка ZnS_xSe_{1-x} CVD-методом	102
--	-----

ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Свиридов А. Н., Филачев А. М., Сагинов Л. Д., Кононов А. С. Мультиспектральный тепловизор	107
Охрем В. Г. Холодильный коэффициент охладителя с составными ветвями	115

Свиридов А. Н. Предельная чувствительность приемных устройств, содержащих CO_2 -квантовый усилитель и смогрящий тепловизор	118
--	-----

Белоконев В. М., Баюканский М. А., Волков В. Г., Саликов В. Л., Украинский С. А. Активно-импульсный ночной бинокль	127
--	-----

Комаров В. В., Фоменко А. Ф., Шергин В. С. ТВ-система "Все Небо" для мониторинга ночной облачности	130
--	-----

<i>Васильева М. Ф., Герасюк А. К., Гоев А. И., Потелов В. В., Сенник Б. Н., Сухачев А. Б., Кириленко В. В., Золотов И. Ю., Ноздрачев А. В.</i> Применение новых пленкообразующих материалов – цирконата гадолиния и цирконата лютеция для получения высококачественных оптических покрытий.....	134
---	-----

Правила для авторов.....	141
--------------------------	-----

От редакции журнала.....	142
--------------------------	-----

ИНФОРМАЦИЯ	143
-------------------------	-----